

Załącznik nr 1 - wykaz urządzeń

L.p.	Laboratorium	Nazwa urządzenia	Producent	Klasa	Tryb pracy	Parametry promieniowania			Nr pom.	Budynek
						Długość fali	Moc średnia (<i>l. ciągłej</i>) Moc szczytowa/energia w impulsie (<i>l. impulsowe</i>)	Czas trwania impulsu (<i>dot. las. impulsowych</i>)		
1	Laboratorium Laserowych Systemów Pomiarowych	Laser półprzewodnikowy		3B	ciągły	z zakresu 1500-1650nm w zależności od lasera	<30mW	nd.	2,09	3
2		Laser jednoczęstotliwościowy 2003 nm	TOPTICA Photonics	3B	ciągły	2003 nm	3mW	nd.	2,09	3
3		Laser 1651 NLK1U5FAAA	NEL/NTT	3B	ciągły	1651 nm	15 mW	nd.	2,09	3
4		Laser przestrajalny półprzewodnikowy	SANTEC	3B	ciągły	1550-1630nm	20mW	nd.	2,13	3
5	Laboratorium Mikroobróbki Laserowej	Q-Switched DPSS Compact Laser Platform	BrightSolutions	4	impulsowy z modulacją dobroci (Q-switch)	532 nm	3W	10-70 ns	2,14	3
6		Zintegrowany system laserowy NT342 (integruje nanosekundowy oscylator optyczny z laserem Nd:YAG z modulacją dobroci)	Ekspla	4	impulsowy z modulacją dobroci (Q-switch)	1064 nm (FF), 532 nm (SH), 355 nm (TH)	400 mJ	3-6 ns	2,14	3
					generator parametryczny	192 - 2600 nm	30 mJ (instrukcja: max. 26 mJ przy 425 nm)	3-6 ns		3
7	LMK (Mikroskopia konfokalna)	Mikroskop Zeiss Cell Observer SD	Zeiss	3B	ciągły	405, 488, 561, 635 lub 639 nm	405 (50mW), 488 (100mW), 561 (40mW), 635 lub 639 nm (30mW)	nd.	1,35	4
8		Mikroskop Leica SP8 MP	Leica	3B/4	ciągły (3B) impulsowy (4)	488 nm, 552 nm, 638 nm; długość nastawiana w zakresie 680-1080 nm	488 (20mW), 552 (20mW), 638 nm (30mW): długość nastawiana w zakresie 680-1080 nm (max. moc przy 800 nm ok. 4W)	nd.	1,28	4
9	Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych	Laser 390-2600 nm	Fianium Ltd	4	impulsowy	390-2600 nm	250 nJ	6ps	3,11	3
10		Laser do pracy ciągłej		3B	ciągły	532 nm	<30mW	nd.	3.09A	3
11		Laser NovaPro 405 nm	RGB Lasersystems	3B	ciągły	405 nm	75 mW	nd.	3,19	3
12		Laser He Cd, model 3301R-G	KIMMON	3B	ciągły	325 nm	30mW	nd.	3.09A	3